

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
【発行日】平成 25 年 6 月 13 日 (2013.6.13)

【公開番号】特開 2011-23710 (P2011-23710A)  
【公開日】平成 23 年 2 月 3 日 (2011.2.3)  
【年通号数】公開・登録公報 2011-005  
【出願番号】特願 2010-132286 (P2010-132286)  
【国際特許分類】

H 0 1 G 11/22 (2013.01)

H 0 1 M 4/139 (2010.01)

【F I】

H 0 1 G 9/00 3 0 1 A

H 0 1 M 4/02 1 0 8

【手続補正書】  
【提出日】平成 25 年 4 月 24 日 (2013.4.24)

【手続補正 1】  
【補正対象書類名】特許請求の範囲  
【補正対象項目名】全文  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【特許請求の範囲】  
【請求項 1】

負極の集電体の表面に、アルカリ金属イオンの吸蔵及び放出が可能な第 1 の層を形成し、  
前記第 1 の層の表面に、アルカリ金属を含む膜を形成して、負極を作製する蓄電デバイスの作製方法であって、

前記第 1 の層に、前記アルカリ金属が含まれた活物質を前記負極として機能させることを特徴とする蓄電デバイスの作製方法。

【請求項 2】

請求項 1 において、前記負極の集電体の表面に、微結晶シリコンを形成し、  
前記微結晶シリコン中の非結晶シリコンを除去して、前記第 1 の層を形成することを特徴とする蓄電デバイスの作製方法。